

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について  
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和7年12月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み [ ]内は研究成果非公開使用料(内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-201	イオン注入装置 日新電機社製 NH-20SR-WMH	公開	可	2,900	5,700	7,200	2,900	4,100	5,400	2,900	2,900	4,000
			不可	/	/	/	/	/	/	/	4,000	5,600
		非公開	不可	/	18,000 [9,900]	22,600 [12,400]	/	/	13,000 [7,200]	17,000 [9,400]	/	9,000 [5,000]
NU-202	急速加熱処理装置 AG Associates社製 Heatpulse610	公開	可	2,000	4,900	5,800	2,000	3,300	4,000	2,000	2,100	2,600
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,900	3,600
		非公開	不可	/	15,900 [8,900]	18,700 [10,500]	/	/	10,900 [6,200]	13,100 [7,500]	/	6,900 [4,000]
NU-204	原子間力顕微鏡 Bruker社製 AXS Dimension3100	公開	可	1,000	4,100	4,900	1,000	2,500	3,100	1,000	1,200	1,700
			不可	/	/	/	/	/	/	/	1,700	2,300
		非公開	不可	/	13,900 [8,100]	16,400 [9,500]	/	/	8,900 [5,400]	10,800 [6,500]	/	4,900 [3,200]
NU-205	3元マグネトロンパツ装置 島津製作所製 HSR-522	公開	可	1,600	4,600	5,600	1,600	3,000	3,800	1,600	1,700	2,400
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,400	3,400
		非公開	不可	/	15,300 [8,800]	18,700 [10,700]	/	/	10,300 [6,100]	13,100 [7,700]	/	6,300 [3,900]
NU-206	電子線露光装置 日本電子社製 JBX6300FS	公開	可	4,100	6,600	8,400	4,100	4,900	6,600	4,100	4,100	5,200
			不可	/	/	/	/	/	/	/	5,200	7,400
		非公開	不可	/	23,300 [14,000]	29,600 [17,600]	/	/	18,300 [11,300]	24,000 [14,600]	/	14,300 [9,100]
NU-207	X線光電子分光装置 VG社製 ESCALAB250	公開	可	2,400	5,300	6,400	2,400	3,700	4,600	2,400	2,400	3,200
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,400	4,500
		非公開	不可	/	17,900 [10,400]	21,500 [12,400]	/	/	12,900 [7,700]	15,900 [9,400]	/	8,900 [5,500]
NU-208	マスクアライナー式 (1)Suss MicroTec AG製 MA-6	公開	可	2,600	5,600	6,700	2,600	4,000	4,900	2,600	2,700	3,500
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,800	4,900
		非公開	不可	/	18,500 [10,600]	22,100 [12,600]	/	/	13,500 [7,900]	16,500 [9,600]	/	9,500 [5,700]
NU-209	ICPエッチング装置一式 サムコ製 RIE-800	公開	可	10,700	12,100	14,000	10,700	10,700	12,200	10,700	10,700	10,800
			不可	/	/	/	/	/	/	/	13,100	15,400
		非公開	不可	/	43,800 [26,600]	50,800 [30,800]	/	/	38,800 [23,900]	45,200 [27,800]	/	34,800 [21,700]
NU-210	ダイシングソー装置 サムコ製 DAD522	公開	可	2,800	5,600	6,600	2,800	4,000	4,700	2,800	2,800	3,300
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,900	4,700
		非公開	不可	/	19,200 [11,200]	22,300 [13,000]	/	/	14,200 [8,500]	16,700 [10,000]	/	10,200 [6,300]
NU-211	フェムト秒レーザー加工分析システム UFL-Hybrid	公開	可	3,800	6,400	8,000	3,800	4,800	6,200	3,800	3,800	4,800
			不可	/	/	/	/	/	/	/	5,000	6,800
		非公開	不可	/	20,100 [11,000]	25,100 [13,700]	/	/	15,100 [8,300]	19,500 [10,700]	/	11,100 [6,100]
NU-213	8元マグネトロンパツ装置	公開	可	1,700	4,700	5,900	1,700	3,100	4,000	1,700	1,900	2,600
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,600	3,700
		非公開	不可	/	14,800 [8,100]	18,300 [10,000]	/	/	9,800 [5,400]	12,700 [7,000]	/	5,800 [3,200]
NU-214	8元MBE装置	公開	可	2,900	5,700	6,900	2,900	4,100	5,100	2,900	2,900	3,700
			不可	/	/	/	/	/	/	/	4,000	5,200
		非公開	不可	/	17,900 [9,800]	21,600 [11,800]	/	/	12,900 [7,100]	16,000 [8,800]	/	8,900 [4,900]
NU-215	ECR-SIMSエッチング装置	公開	可	1,100	4,200	5,200	1,100	2,600	3,400	1,100	1,400	2,000
			不可	/	/	/	/	/	/	/	1,900	2,800
		非公開	不可	/	13,200 [7,200]	16,300 [8,900]	/	/	8,200 [4,500]	10,700 [5,900]	/	4,200 [2,300]
NU-216	スプレーコーター式 サンメイ製 DC110	公開	可	1,800	5,000	5,800	1,800	3,400	4,000	1,800	2,100	2,600
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,000	3,600
		非公開	不可	/	15,600 [8,500]	18,100 [9,900]	/	/	10,600 [5,800]	12,500 [6,900]	/	6,600 [3,600]
NU-218	電気炉 光洋リンドバーク社製 MODEL272-2	公開	可	2,700	5,500	6,600	2,700	3,900	4,700	2,700	2,700	3,300
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,700	4,700
		非公開	不可	/	17,200 [9,400]	20,500 [11,200]	/	/	12,200 [6,700]	14,900 [8,200]	/	8,200 [4,500]

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について  
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和7年12月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み □内は研究成果非公開使用料(内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-219	酸化・拡散炉 光洋リンドバーク社製 MODEL270-M100	公開	可	1,900	5,100	6,300	1,900	3,500	4,500	1,900	2,200	3,100
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,100	4,400
		非公開	不可	/	15,900 (8,700)	19,800 (10,800)	/	/	10,900 (6,000)	14,200 (7,800)	/	6,900 (3,800)
NU-220	小型微細形状測定機一式 小坂研究所製 ET200	公開	可	1,700	4,900	5,600	1,700	3,300	3,800	1,700	2,000	2,400
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,800	3,400
		非公開	不可	/	15,200 (8,300)	17,600 (9,600)	/	/	10,200 (5,600)	12,000 (6,800)	/	6,200 (3,400)
NU-221	プラズマCVD装置 サムコ製 PD-240	公開	可	1,700	4,700	5,800	1,700	3,100	4,000	1,700	1,900	2,600
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,600	3,600
		非公開	不可	/	14,800 (8,100)	18,100 (9,900)	/	/	9,800 (5,400)	12,500 (6,900)	/	5,800 (3,200)
NU-222	レーザー描画装置 Heidelberg Instruments社製 DWL66FS	公開	可	1,600	4,600	5,600	1,600	3,000	3,800	1,600	1,700	2,400
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,400	3,300
		非公開	不可	/	14,900 (8,400)	18,000 (10,100)	/	/	9,900 (5,700)	12,400 (7,100)	/	5,900 (3,500)
NU-223	フトリソグラフィ装置 ウソ電機社製 マルチライトML251A/B、 共和理研社製 スピンナーK-359SD-1	公開	可	1,300	4,300	5,400	1,300	2,700	3,500	1,300	1,400	2,100
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,000	3,000
		非公開	不可	/	13,800 (7,700)	17,100 (9,500)	/	/	8,800 (5,000)	11,500 (6,500)	/	4,800 (2,800)
NU-224	電子ビーム蒸着装置 アルバック社製 EBX-10D	公開	可	1,700	4,700	5,600	1,700	3,100	3,800	1,700	1,800	2,400
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,500	3,300
		非公開	不可	/	14,900 (8,300)	17,900 (10,000)	/	/	9,900 (5,600)	12,300 (7,000)	/	5,900 (3,400)
NU-225	ICPエッチング装置 アルバック社製 CE-300I  ( )内は1回あたりの料金 ※試料を高真空中に保持し作製(約8時間)する場合	公開	可	2,400 (28,500)	5,200 (61,900)	6,300 (72,100)	2,400 (28,500)	3,600 (43,100)	4,500 (50,800)	2,400 (28,500)	2,400 (28,500)	3,100 (33,800)
			不可	/	7,400 (88,300)	8,900 (102,900)	/	5,100 (61,500)	6,300 (72,500)	/	3,300 (40,000)	4,300 (48,200)
		非公開	不可	/	17,000 (9,600) (203,400)	20,300 (11,400) (236,100)	/	12,000 (6,900) (144,100)	14,700 (8,400) (169,000)	/	8,000 (4,700) (96,600)	10,200 (5,900) (115,300)
NU-226	RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR	公開	可	1,400	4,400	5,100	1,400	2,800	3,300	1,400	1,500	1,900
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,100	2,600
		非公開	不可	/	14,300 (8,100)	16,600 (9,400)	/	9,300 (5,400)	11,000 (6,400)	/	5,300 (3,200)	6,500 (3,900)
NU-227	走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールディング社製 S5200	公開	可	1,900	4,800	5,900	1,900	3,200	4,100	1,900	1,900	2,700
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,700	3,800
		非公開	不可	/	16,000 (9,200)	19,500 (11,100)	/	11,000 (6,500)	13,900 (8,100)	/	7,000 (4,300)	9,400 (5,600)
NU-228	走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールディング社製 S4300	公開	可	2,100	5,000	6,000	2,100	3,400	4,200	2,100	2,100	2,800
			不可	/	/	/	/	/	/	/	3,000	3,900
		非公開	不可	/	15,600 (8,500)	18,700 (10,200)	/	10,600 (5,800)	13,100 (7,200)	/	6,600 (3,600)	8,600 (4,700)
NU-231	マスクレス露光装置 ナノシステムソリューションズ製 DL-1000	公開	可	1,800	4,900	5,900	1,800	3,300	4,100	1,800	2,100	2,700
			不可	/	/	/	/	/	/	/	2,900	3,800
		非公開	不可	/	15,400 (8,400)	18,500 (10,100)	/	10,400 (5,700)	12,900 (7,100)	/	6,400 (3,500)	8,400 (4,600)
NU-232	原子層堆積装置 サムコ製 AD-100LE	公開	可	4,400	7,000	8,200	4,400	5,400	6,400	4,400	4,400	5,000
			不可	/	/	/	/	/	/	/	5,800	7,100
		非公開	不可	/	21,800 (11,900)	25,800 (14,100)	/	16,800 (9,200)	20,200 (11,100)	/	12,800 (7,000)	15,700 (8,600)
NU-233	蛍光りん光分光光度計 堀場製作所製 Fluoromax-4P	公開	可	200	3,800	4,400	200	2,100	2,600	200	900	1,200
			不可	/	/	/	/	/	/	/	1,200	1,600
		非公開	不可	/	11,700 (6,400)	13,600 (7,400)	/	6,700 (3,700)	8,000 (4,400)	/	2,700 (1,500)	3,500 (1,900)
NU-234	ICPエッチング装置 サムコ社製 RIE-200iPN	公開	可	3,100	5,900	7,000	3,100	4,300	5,200	3,100	3,100	3,800
			不可	/	/	/	/	/	/	/	4,300	5,400
		非公開	不可	/	18,500 (10,100)	22,000 (12,000)	/	13,500 (7,400)	16,400 (9,000)	/	9,500 (5,200)	11,900 (6,500)

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について  
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和7年12月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み □内は研究成果非公開使用料(内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-235	超高密度大気圧プラズマ装置 富士機械製造(株)社製	公開	可	700	3,900	4,500	700	2,300	2,700	700	1,000	1,300
			不可	/	5,500	6,400	/	3,200	3,800	/	1,400	1,800
		非公開	不可	/	12,600 [7,100]	14,600 [8,200]	/	7,600 [4,400]	9,000 [5,200]	/	3,600 [2,200]	4,500 [2,700]
NU-236	In-situ 電子スピン共鳴(ESR) Bruker社製 EMX Premium X	公開	可	2,000	4,900	5,700	2,000	3,300	3,900	2,000	2,100	2,500
			不可	/	7,000	8,100	/	4,700	5,500	/	2,900	3,500
		非公開	不可	/	16,200 [9,200]	18,700 [10,600]	/	11,200 [6,500]	13,100 [7,600]	/	7,200 [4,300]	8,600 [5,100]
NU-237	ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置	公開	可	1,900	4,900	5,900	1,900	3,300	4,000	1,900	2,000	2,600
			不可	/	6,900	8,300	/	4,600	5,700	/	2,800	3,700
		非公開	不可	/	16,500 [9,600]	19,700 [11,400]	/	11,500 [6,900]	14,100 [8,400]	/	7,500 [4,700]	9,600 [5,900]
NU-238	高温プロセス用誘導結合型プラズマエッチング装置 NUシステム製 NU-RC/Cl-Etch	公開	可	2,800	5,600	6,500	2,800	4,000	4,700	2,800	2,800	3,300
			不可	/	7,900	9,200	/	5,600	6,600	/	3,800	4,600
		非公開	不可	/	19,200 [11,300]	22,200 [13,000]	/	14,200 [8,600]	16,600 [10,000]	/	10,200 [6,400]	12,100 [7,500]
NU-239	表面解析プラズマビーム装置 NUシステム製 LIA-Plasma Beam/CF&Cl System	公開	可	3,800	6,300	8,400	3,800	4,700	6,600	3,800	3,800	5,200
			不可	/	9,000	12,000	/	6,700	9,400	/	4,900	7,400
		非公開	不可	/	23,000 [14,000]	30,000 [18,000]	/	18,000 [11,300]	24,400 [15,000]	/	14,000 [9,100]	19,900 [12,500]
NU-240	in-situプラズマ照射表面分析装置	公開	可	2,900	5,600	7,000	2,900	4,000	5,200	2,900	2,900	3,800
			不可	/	8,000	10,000	/	5,700	7,400	/	3,900	5,400
		非公開	不可	/	20,400 [12,400]	25,200 [15,200]	/	15,400 [9,700]	19,600 [12,200]	/	11,400 [7,500]	15,100 [9,700]
NU-243	真空紫外吸収分光計(原子ラジカルモニター) NUシステム社製	公開	可	2,900	5,700	6,500	2,900	4,100	4,700	2,900	2,900	3,300
			不可	/	8,100	9,200	/	5,800	6,600	/	4,000	4,600
		非公開	不可	/	17,900 [9,800]	20,300 [11,100]	/	12,900 [7,100]	14,700 [8,100]	/	8,900 [4,900]	10,200 [5,600]
NU-244	レーザ描画装置一式 Heidelberg製 mPG101-UV	公開	可	3,100	5,900	6,900	3,100	4,300	5,100	3,100	3,100	3,700
			不可	/	8,400	9,800	/	6,100	7,200	/	4,300	5,200
		非公開	不可	/	20,300 [11,900]	23,600 [13,800]	/	15,300 [9,200]	18,000 [10,800]	/	11,300 [7,000]	13,500 [8,300]
NU-245	スパッタリング装置一式 キャノンアネルパ製 E-200S	公開	可	4,100	6,700	7,800	4,100	5,100	6,000	4,100	4,100	4,600
			不可	/	9,500	11,100	/	7,200	8,500	/	5,400	6,500
		非公開	不可	/	23,100 [13,600]	27,000 [15,900]	/	18,100 [10,900]	21,400 [12,900]	/	14,100 [8,700]	16,900 [10,400]
NU-246	超臨界乾燥機 KISCO製 SCLEAD3CD2000	公開	可	700	4,000	4,700	700	2,400	2,900	700	1,200	1,500
			不可	/	5,700	6,700	/	3,400	4,100	/	1,600	2,100
		非公開	不可	/	12,900 [7,200]	15,100 [8,400]	/	7,900 [4,500]	9,500 [5,400]	/	3,900 [2,300]	5,000 [2,900]
NU-247	ナノインプリント装置一式 SCIVAX製 X-300 BVU-ND	公開	可	1,800	5,000	6,000	1,800	3,400	4,200	1,800	2,100	2,800
			不可	/	7,100	8,500	/	4,800	5,900	/	3,000	3,900
		非公開	不可	/	16,100 [9,000]	19,300 [10,800]	/	11,100 [6,300]	13,700 [7,800]	/	7,100 [4,100]	9,200 [5,300]
NU-248	バリレンコーティング装置一式 KISCO製 DACS-LAB	公開	可	500	3,900	4,500	500	2,300	2,700	500	1,000	1,300
			不可	/	5,500	6,400	/	3,200	3,800	/	1,400	1,800
		非公開	不可	/	12,100 [6,600]	14,100 [7,700]	/	7,100 [3,900]	8,500 [4,700]	/	3,100 [1,700]	4,000 [2,200]

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について  
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和7年12月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み [ ]内は研究成果非公開使用料(内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-249	高精度電子線描画装置一式	公開	可	5,300	7,800	9,100	5,300	6,200	7,300	5,300	5,300	5,900
			不可	/	11,100	13,000	/	8,800	10,400	/	7,000	8,400
	日本電子㈱製 SPG-724	非公開	不可	/	24,500 [13,400]	28,700 [15,700]	/	19,500 [10,700]	23,100 [12,700]	/	15,500 [8,500]	18,600 [10,200]
NU-250	マスクアライナー式	公開	可	1,300	4,600	5,400	1,300	3,000	3,600	1,300	1,700	2,200
			不可	/	6,500	7,700	/	4,200	5,100	/	2,400	3,100
	(2)Suss MicroTec AG製 MJB-3	非公開	不可	/	14,300 [7,800]	16,900 [9,200]	/	9,300 [5,100]	11,300 [6,200]	/	5,300 [2,900]	6,800 [3,700]
NU-251	マスクアライナー式	公開	可	1,100	4,500	5,300	1,100	2,900	3,500	1,100	1,700	2,100
			不可	/	6,400	7,500	/	4,100	4,900	/	2,300	2,900
	(3)ナノテック製 LA410	非公開	不可	/	14,100 [7,700]	16,500 [9,000]	/	9,100 [5,000]	10,900 [6,000]	/	5,100 [2,800]	6,400 [3,500]
NU-252	蛍光バイオイメージング装置一式	公開	可	1,100	4,300	5,200	1,100	2,700	3,400	1,100	1,400	2,000
			不可	/	6,100	7,400	/	3,800	4,800	/	2,000	2,800
	共焦点レーザ顕微鏡システム ニコン製 AIRSi-N	非公開	不可	/	13,400 [7,300]	16,300 [8,900]	/	8,400 [4,600]	10,700 [5,900]	/	4,400 [2,400]	6,200 [3,400]
NU-253	SEM用断面試料作製装置	公開	可	700	4,100	4,700	700	2,500	2,800	700	1,200	1,400
			不可	/	5,800	6,600	/	3,500	4,000	/	1,700	2,000
	JEOL製 SM-09010	非公開	不可	/	12,800 [7,000]	14,500 [7,900]	/	7,800 [4,300]	8,900 [4,900]	/	3,800 [2,100]	4,400 [2,400]
NU-254	デジタルマイクロスコープ式	公開	可	1,000	4,200	4,900	1,000	2,600	3,100	1,000	1,400	1,700
			不可	/	6,000	7,000	/	3,700	4,400	/	1,900	2,400
	KEYENCE製 VK-9700	非公開	不可	/	13,200 [7,200]	15,400 [8,400]	/	8,200 [4,500]	9,800 [5,400]	/	4,200 [2,300]	5,300 [2,900]
NU-255	デジタルマイクロスコープ式	公開	可	800	4,000	4,600	800	2,400	2,800	800	1,100	1,400
			不可	/	5,600	6,500	/	3,300	3,900	/	1,500	1,900
	KEYENCE製 VK-9510	非公開	不可	/	12,300 [6,700]	14,300 [7,800]	/	7,300 [4,000]	8,700 [4,800]	/	3,300 [1,800]	4,200 [2,300]
NU-256	Deep Si Etcher	公開	可	8,900	10,500	12,600	8,900	8,900	10,800	8,900	8,900	9,400
			不可	/	15,000	17,900	/	12,700	15,300	/	10,900	13,300
	住友精密工業製 Multiplex-ASE	非公開	不可	/	33,100 [18,100]	39,500 [21,600]	/	28,100 [15,400]	33,900 [18,600]	/	24,100 [13,200]	29,400 [16,100]
NU-257	露光プロセス装置一式	公開	可	800	4,000	4,700	800	2,400	2,900	800	1,100	1,500
			不可	/	5,600	6,700	/	3,300	4,100	/	1,500	2,100
	ユニオン光学社製 PEM800	非公開	不可	/	12,300 [6,700]	14,700 [8,000]	/	7,300 [4,000]	9,100 [5,000]	/	3,300 [1,800]	4,600 [2,500]
NU-258	フーリエ変換赤外分光分析装置	公開	可	1,100	4,200	5,100	1,100	2,600	3,300	1,100	1,400	1,900
			不可	/	6,000	7,200	/	3,700	4,600	/	1,900	2,600
	日本分光社製 FT/IR-615V型	非公開	不可	/	13,200 [7,200]	15,800 [8,600]	/	8,200 [4,500]	10,200 [5,600]	/	4,200 [2,300]	5,700 [3,100]
NU-259(1)	磁気特性評価システム	公開	可	1,300	4,400	5,200	1,300	2,800	3,300	1,300	1,500	1,900
			不可	/	6,200	7,300	/	3,900	4,700	/	2,100	2,700
	(1)交番磁界勾配型磁力計	非公開	不可	/	13,700 [7,500]	16,100 [8,800]	/	8,700 [4,800]	10,500 [5,800]	/	4,700 [2,600]	6,000 [3,300]
NU-259(2)	磁気特性評価システム	公開	可	1,300	4,500	5,300	1,300	2,800	3,500	1,300	1,600	2,100
			不可	/	6,300	7,500	/	4,000	4,900	/	2,200	2,900
	(5)振動試料型磁力計 TM-VSM271483-HGC	非公開	不可	/	13,900 [7,600]	16,500 [9,000]	/	8,900 [4,900]	10,900 [6,000]	/	4,900 [2,700]	6,400 [3,500]
NU-259(3)	磁気特性評価システム	公開	可	1,000	4,200	4,900	1,000	2,600	3,100	1,000	1,400	1,700
			不可	/	6,000	7,000	/	3,700	4,400	/	1,900	2,400
	(3)トルク磁力計	非公開	不可	/	13,200 [7,200]	15,400 [8,400]	/	8,200 [4,500]	9,800 [5,400]	/	4,200 [2,300]	5,300 [2,900]
NU-259(4)	磁気特性評価システム	公開	可	1,200	4,300	5,200	1,200	2,700	3,400	1,200	1,400	2,000
			不可	/	6,100	7,400	/	3,800	4,800	/	2,000	2,800
	(4)磁気光学スペクトロメータ	非公開	不可	/	13,400 [7,300]	16,300 [8,900]	/	8,400 [4,600]	10,700 [5,900]	/	4,400 [2,400]	6,200 [3,400]
NU-260	マスクレス露光装置	公開	可	1,300	4,500	5,200	1,300	2,800	3,300	1,300	1,600	1,900
			不可	/	6,300	7,300	/	4,000	4,700	/	2,200	2,700
	ネオアーク製 PALET DDB-701-DL4	非公開	不可	/	13,900 [7,600]	16,100 [8,800]	/	8,900 [4,900]	10,500 [5,800]	/	4,900 [2,700]	6,000 [3,300]

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について  
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和7年12月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み [ ]内は研究成果非公開使用料(内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-261	段差計 小坂研究所製 ET200A	公開	可	1,100	4,200	4,900	1,100	2,600	3,100	1,100	1,400	1,700
			不可	/	6,000	6,900	/	3,700	4,300	/	1,900	2,300
		非公開	不可	/	13,200 〔7,200〕	15,200 〔8,300〕	/	8,200 〔4,500〕	9,600 〔5,300〕	/	4,200 〔2,300〕	5,100 〔2,800〕
NU-262	プラズマ誘起CVD装置 サムコ社製 PD-220N	公開	可	4,200	6,800	8,000	4,200	5,200	6,100	4,200	4,200	4,700
			不可	/	9,700	11,300	/	7,400	8,700	/	5,600	6,700
		非公開	不可	/	21,400 〔11,700〕	24,900 〔13,600〕	/	16,400 〔9,000〕	19,300 〔10,600〕	/	12,400 〔6,800〕	14,800 〔8,100〕
NU-263	高分解能走査型電子顕微鏡 日本電子製 JSM-IT800SHL	公開	可	1,500	4,500	5,400	1,500	2,900	3,600	1,500	1,700	2,200
			不可	/	6,400	7,700	/	4,100	5,100	/	2,300	3,100
		非公開	不可	/	15,400 〔9,000〕	18,500 〔10,800〕	/	10,400 〔6,300〕	12,900 〔7,800〕	/	6,400 〔4,100〕	8,400 〔5,300〕
NU-264	原子間力顕微鏡 パーク・システムズ社製 NX20	公開	可	1,300	4,400	5,200	1,300	2,800	3,300	1,300	1,500	1,900
			不可	/	6,200	7,300	/	3,900	4,700	/	2,100	2,700
		非公開	不可	/	15,000 〔8,800〕	17,600 〔10,300〕	/	10,000 〔6,100〕	12,000 〔7,300〕	/	6,000 〔3,900〕	7,500 〔4,800〕
NU-265	物理特性測定装置 日本カンタム・デザイン社製 DynaCool-12T	公開	可	2,300	5,200	6,100	2,300	3,500	4,300	2,300	2,300	2,900
			不可	/	7,300	8,700	/	5,000	6,100	/	3,200	4,100
		非公開	不可	/	17,500 〔10,200〕	20,700 〔12,000〕	/	12,500 〔7,500〕	15,100 〔9,000〕	/	8,500 〔5,300〕	10,600 〔6,500〕
NU-266	全自動X線回折装置 リガク製 SmartLab 9kW	公開	可	1,700	4,700	5,600	1,700	3,100	3,800	1,700	1,900	2,400
			不可	/	6,700	8,000	/	4,400	5,400	/	2,600	3,400
		非公開	不可	/	16,000 〔9,300〕	18,900 〔10,900〕	/	11,000 〔6,600〕	13,300 〔7,900〕	/	7,000 〔4,400〕	8,800 〔5,400〕
NU-267	RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR	公開	可	1,900	4,900	5,700	1,900	3,300	3,900	1,900	2,000	2,500
			不可	/	6,900	8,100	/	4,600	5,500	/	2,800	3,500
		非公開	不可	/	16,200 〔9,300〕	18,900 〔10,800〕	/	11,200 〔6,600〕	13,300 〔7,800〕	/	7,200 〔4,400〕	8,800 〔5,300〕
NU-268	電子線描画用データ処理ソフトウェア GenSys社製 BEAMER	公開	可	1,700	4,700	5,400	1,700	3,100	3,600	1,700	1,900	2,200
			不可	/	6,700	7,700	/	4,400	5,100	/	2,600	3,100
		非公開	不可	/	14,800 〔8,100〕	16,900 〔9,200〕	/	9,800 〔5,400〕	11,300 〔6,200〕	/	5,800 〔3,200〕	6,800 〔3,700〕

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金(加算額)

☆上記共用機器使用料は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の採択により軽減されております。  
事業終了後は、通常の料金設定となります。

II 算出内訳 別紙1のとおり

III 項目別算出基礎 別紙2のとおり

IV 解析手数料(1時間あたり)

単位:円、消費税込み

解析手数料	学内者		学外者	
	非営利法人		営利法人	
	/	5,900	6,600	

V 算出基礎 別紙3のとおり